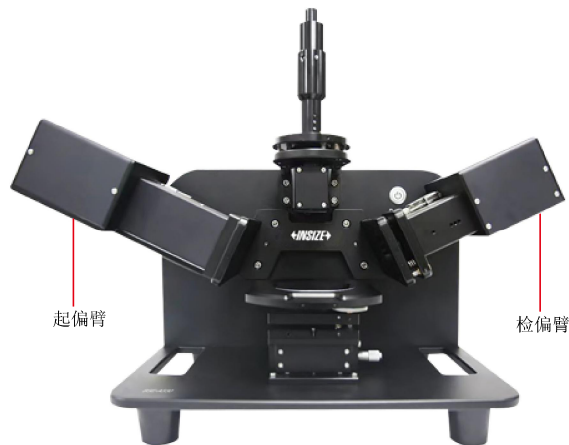




光谱椭偏仪

型号 BSE-A550-Y

- 符合JJF椭偏仪国家计量校准规范
- 适用于科研, 半导体, 光伏, 光学镀膜, 显示面板等领域
- 基于双旋转补偿器调制技术一次性获取Psi(Ψ)/Delta(Δ)、N/C/S等光谱, 可实现基底上单层到多层微纳薄膜膜厚及光学特性的快速分析
- 用于测量衬底以及膜层的厚度d, 折射率n, 消光系数k, 介电常数 ϵ 等参数
- 包含数百种材料数据库、多种算法模型



技术参数

光谱范围		400~800nm
光谱准确性		Psi(Ψ): 90%以上波长点与模型偏差 $\leq \pm 0.1$, Delta(Δ): 90%以上波长点与模型偏差 $\leq \pm 0.2$ (25nm硅基SiO ₂ 薄膜, 差值模型)
入射角		固定角, 65°
光斑大小		1~4mm
找焦方式		最大光强手动找焦
最大样品直径		Ø180mm
膜厚	量程	1~1000nm
	精度	<0.5nm (100nm硅基SiO ₂ 薄膜)
	重复性	优于0.02nm (100nm硅基SiO ₂ 薄膜, 30次, 1 σ)
折射率	精度	± 0.009 (100nm硅基SiO ₂ 薄膜, 可见光波段)
	重复性	优于0.001 (100nm硅基SiO ₂ 薄膜, n@632.8nm, 30次, 1 σ)
单点测量时间		≤ 10 s
卤素灯光源		工作寿命2000小时
Z轴位移行程		0~10mm
样件台俯仰角度		$> \pm 2^\circ$, 手动调节
算法模型		光学常数模型以及振子模型(Cauchy模型、Sellmeier模型、Lorentz模型、Gaussian模型、Drude模型等) 支持图形化多振子混合模型拟合功能, B样条拟合功能
工作环境		温度: 20~26°C, 湿度: 35%~60%RH, 洁净度: Class10000
电源		220V, 50Hz
尺寸(长×宽×高)		675×325×525mm
重量		65kg

标准配置

主机	1 个
电脑	1 个
标准硅片	1 套
安装工具	1 套
稳压电源	1 个

选配

隔振平台	0790-B88A
负压吸附泵	BSE-A550-PUMP